

傾斜回転式プラズマ強化化学気相成長（Pecvd）管状炉

商品番号: KT-PE16



前書き

精密な薄膜堆積のための高度なPECVD管状炉。均一な加熱、RFプラズマ源、カスタマイズ可能なガス制御。半導体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	PE-1600-60
最高温度	1600°C
常用温度	1550°C
炉心管材質	高純度Al2O3管
炉心管径	60mm
加熱ゾーン長	2x300mm
炉内材質	日本製アルミナファイバー
加熱素子	二珪化モリブデン
昇温速度	0-10°C/min
熱電対	Bタイプ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1°C
RFプラズマユニット	
出力電力	5 -500W 調整可能（±1%の安定性）
RF周波数	13.56 MHz ±0.005%の安定性
反射電力	最大350W
マッチング	自動
ノイズ	<50 dB
冷却	空冷
ガス精密制御ユニット	
流量計	MFC質量流量計
ガスチャンネル	4チャンネル
流量	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
直線性	±0.5% F.S.

繰り返し精度	±0.2% F.S.
配管およびバルブ	ステンレス鋼
最大動作圧力	0.45MPa
流量計コントローラー	デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー
標準真空ユニット（オプション）	
真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ排気速度	4L/S
真空吸気口	KF25
真空計	ピラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧	10Pa
高真空ユニット（オプション）	
真空ポンプ	ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ
ポンプ排気速度	4L/S + 110L/S
真空吸気口	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧	6x10 ⁻⁵ Pa
上記の仕様およびセットアップはカスタマイズ可能です	

No.	説明	数量
1	炉本体	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	管状断熱ブロック	2
5	断熱ブロック用フック	1
6	耐熱手袋	1
7	RFプラズマ源	1
8	精密ガス制御装置	1
9	真空ユニット	1
10	取扱説明書	1